19日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平4-10979

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月16日

B 41 M 5/26 G 11 B 7/24

B 7215-5D A 7215-5D

7215-5D 8305-2H B 41 M

X

審査請求 未請求 請求項の数 9 (全4頁)

5/26

❷発明の名称 光記録媒体と光記録媒体の製造方法

②特 願 平2-113380

②出 願 平2(1990)4月27日

個発 明 者 古 Ш 惠 昭 @発 明 者 内 田 Œ 美 ⑫発 明 者 太 \blacksquare 威 夫 @発 明 者 出 己 青

大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社內 松下電器産業株式会社內 松下電器産業株式会社內 松下電器産業株式会社內

切出 願 人 松下電器産業株式会社砂代 理 人 弁理士 粟 野 重 孝

大阪府門真市大字門真1006番地

外1名

明細會

- 発明の名称
 光記録媒体と光記録媒体の製造方法
- 2. 特許請求の範囲
- (1) レーザ光等の照射により、状態の変化がなされ、GeTeとSbaTeaとSbの混合体に窒素を含ませた材料からなる記録層を基板上に形成した光記録媒体。
- (2) GeTeとSb*Te*とSbの混合体に 窒果を含ませてなる記録層を アルゴンと窒素の混合ガスを用いたスパッタ法で形成することを特徴とする光記録媒体の製造方法。
- (3) 記録層を形成する時の窒素分圧を10-6~10-6 Torrの範囲にすることを特徴とする請求項 2 記載 の光記録媒体の製造方法。
- (4) 記録層の組成がGeTe/Sb₂Te₃のモル比を g として 0.5≤g≤2.3である請求項Ⅰ記載の光記録媒体。
- (5) 記録層の組成がSb/Sb₂Te₃のモル比を b として□ ≤ b ≤ T . 0 である請求項 1 記載の光記録媒

体。

- (6) 記録層の組成がGeTe/Sb*Te*のモル比を g として、 0.5 ≤ g ≤ 2.3 の範囲でかつ、Sb/Sb*Te*のモル比を b として、 0.1 ≤ b ≤ 1.0 である 請求項1 記載の光記録媒体。
- (7) 基板上に第1の保護層と GeTeとSbaTeaとSb の混合体に窒素を含ませた材料からなる記録層と 第2の保護層と 反射層とを順次形成した光記録 媒体
- (8) 基板上に第1の誘電体層と、GeTeとSb*Te*とSbの混合体に窒素を含ませた材料からなる記録層と、第2の保護層と、反射層とを備え、第2の保護層を第1の保護層より薄くし、第2の保護層の膜厚を30nm以下にした請求項7記載の光記録媒体
- (9) 第1及び 第2の保護層を ZnSとSiOa の混合体とし SiOa比が5~40モルXとした請求項7記載の光記録媒体
- 3. 発明の群細な説明 産業上の利用分野

本発明はレーザービーム等により、 情報を高密 度 大容量で記録再生及び消去できる光記録媒体 に関するものである。

従来の技術

大容量で高密度なメモリとして光記録媒体が注 目されており、 現在 情報の消去・再記録が可能 である書換え型と呼ばれるものの開発が進められ ている。 この書換え型の光記録媒体のひとつとし て、Te-Ge-Sb合金韓膜を記録層として用い レー ザ光の照射により記録層を加熱し 溶融し 急冷 することにより非晶質化して情報を記録し また これを加熱し徐冷することにより結晶化して情報 を消去するものがある。 第3図は従来の春換え型 光記録媒体を示した断面図である。 第3図におい て、 中心穴を有する円盤上の透明樹脂材料からな る基板11に誘電体からなる第1の保護層 1 2、 記録層13、誘電体からなる第2の保護層14、 金属薄膜からなる反射層15を形成し その上に 接着剤16を介して保護板17を設けたものであ る。ここで、記録層13にTe-Ge-Sb合金薄膜を用 いれば、この結晶化速度が速いため、単一のレーザの強度を変調して照射するだけで非晶質化及び結晶化ができる。 従って、この書換え型光記録媒体は、一般にオーバライトと呼ばれる単一のレーザ光による情報の書換えが可能である。

発明が解決しょうとする課題

GeTe、Sb*Te*、Sbの混合体を用いれば Sbの量を選当とにすることによる信号品質のである。 Manual ののである。 Bbが結晶化のの質がは、Sbが結晶化のの質がは、Sbが結晶化のの質がは、Bbが結晶化のの質がは、Bbが結晶化のの質がは、Bbが結晶化のの質がは、Bbがは、Bb、Bb*Te*に、Bb*Te*に、Bb

消去特性についてはTeを含む非晶質膜は その 融点は代表的なもので400℃~900℃と広い温度範囲にあり、 これらの記録薄膜にレーザ光を照射 し 昇温徐冷することにより結晶化が行える。 この温 度は一般的に融点より低い結晶化温度領域にある

またこの結晶化した膜に高いパワーレベルのレー ザ光をあて、 その融点以上に加熱するとその部分 は溶融し急冷し 再び非晶質化してマークが形成 できる。 記録マークとして非晶質化を選ぶと、 こ のマークは記録薄膜が溶融し急冷されて形成され るものであるから 冷却速度が速いほど非晶質状 態の均一なものが得られ信号振幅が向上する。 冷 却速度が遅い場合はマークの中心と周辺で非晶質 化の程度に差が発生する。次に結晶化消去に際し ては レーザ光の照射により既に記録が行われて いる非晶質マーク部を、 結晶化温度以上に昇温し 徐冷して 結晶化させてこのマークを消去する この時 マークが均一に結晶化するときは消去特 性が向上する。 しかし、 記録マークの状態が不均 一な場合は 記録マーク部の反射率や吸収率にむ らが発生しやすく、 消去した時に 結晶化の状態 が不均一となり、 記録マークの消し残りが発生し 消去特性が劣化するという課題があった。 本発明 の目的は サイクル特性が安定であり、 記録消去 特性の良好な光ディスクを提供することである。

課題を解決するための手段

本発明は レーザ光等の照射により、状態の変化がなされ、GeTeとSb2Te3とSbの混合体に窒素を含ませた材料からなる記録層を基板上に形成したものである。

作用

本発明は上記した構成 すなわち GeTe-Sb2Te3-Sbの混合体に 窒素を含ませた材料を基板上に形成することで 記録・再生・消去の繰り返しに伴う加熱・冷却の繰り返しにより記録層材料が脈動し案内溝に沿って移動する現象を抑制することができ、これによって記録・消去の繰り返し特性を向上することができるものである。

また基板上に第1の保護層と、GeTeとSb*Te*とSbの混合体に窒素を含ませた材料からなる記録層と、第2の誘電体層と、反射層とを備え、第2の誘電体層を第1の保護層より薄くし30nm以下にしているので、金属からなる反射層と記録層を近づけることになり、記録層が急冷され、記録マークが均一な非晶質状態となる。その結果、記録・

の組成である余剰のSbを含む組成のものに比べ 局所的な偏折に対する阻止効果が低かった。 また b=1.0 を越える組成領域では 記録・消去の 繰り返しにおいて非晶質化劣化が生じやすい。 ゆ えに $0 \le b \le 1.0$ の組成領域が繰り返し特性 が良好であり好ましい。

g = GeTe/SbaTe。については $g \not m 0.5$ 以下になると 結晶化転移温度が低下し 耐熱安定性が小さくなる。 g = 2.3を越える組成領域では熱的安定性が良好であるが感度が低下する。 ゆえに $0.5 \le g \le 2.3$ が良好であり好ましい。

第1及び第2の保護圏 記録圏 反射層の形成方法としては 一般的には真空蒸着あるいはスパッタ法が使用できる。 本実施例では記録層の形成方法としてアルゴンと窒素の混合ガスによるスパッタ法を用いている。 この時 窒素の分圧が特性あるいは膜質を決定する上で重要であるが 記録薄膜のスパッタ時の窒素分圧は10-4~1.0×10-4T orrの範囲が適当である。 この理由は窒素分圧を10-4 Torrよりな小さくすると GeTe.Sb2Te3.Sb

消去が向上する。

実 施 例

以下、本発明の一実施例の光記録媒体を図面に 基づいて説明する。 第1図は本発明の一実施例を 示す断面図である 第1図において 中心孔を有 する円盤上の透明な基板1上にあらかじめ耐熱性 の優れた2nS-SiO₂からなる第1の保護層2を形成 する。 組成比はSiOz含有量が約20モル%であり、 膜厚は約150 nmである。 3 は記録層でGeTe, Sb ∗Te∗, Sbに窒素を混合した薄膜であり、 膜厚は約 20 nmである。 4 は第2の保護層で第1の保護層 2と同じ材料からなっており、 腹厚は約20 nmで ある。 5 はA1合金からなる反射層で膜厚は約10 0 nmである。 6 は保護板で接着剤 7 によって基板 1に貼り合わせている。 記録層 3を構成する材料 のうちのGeTe, Sb2Te3, Sbの組成としては 第2図 の GeTe, Sb2Tc3, Sbからなる三角ダイアグラムにお いて、 b = Sb/Sb2Te3 = 0 及びb = 1.0の両う インの内側に選ぶ bが0よりも少ない組成領域 すなわち余剰のTeを含む組成領域では 本実施例

に含まれる窒素が少なくなり、 記録層 3 の材料が脈動して、 案内溝に添って移動する現象を阻止する効果が小さくなる。 逆に窒素分圧を10-4 Torrよりもを大きくすると、 記録層の屈折率等 光学的な特性の変化 あるいは結晶化速度 非晶質化速度等 記録消去にかかわる基本的な特性が変化してしまう。 ゆえに 窒素分圧は10-6~1.0×10-4 Torrの範囲が適当である。

第 1、 第 2 の保護層 2 . 4 の 2 n S - Si 10 2 混合 膜は Si 0 2 の 比率を 2 0 モル%にしているがこれに限定するものではない。 しかしながら Si 0 2 の 比率を 5 モル%以下にする と Zn Sに Si 0 2 を 混合した時に得られる 効果 すなわち 結晶 粒径を小さくするという 効果が小さく なり 4 0 モル%を 越えるとと Si 0 2 膜の性質が大きくなるものであるから Si 0 2 の 比率は 5 ~ 4 0 モル%の範囲にするのが適当である。

さらに 第2の保護層4の膜厚を約30 nmと薄くしているが これよって熱拡散層となる反射層5と記録層3が近くなり、記録・消去時の記録層

3 の熱が急速に反射層 5 に伝達されることになって、記録層 3 を急冷し、記録マークが均一な非晶質状態となる。その結果、記録・消去が向上する。本実施例のディスク構成で、外径 1 3 0 mm、 1 8 0 0 rpm回転、線速度 8 m/secで f1 = 3 . 4 3 MHz の信号、f2 = 1 . 2 5 MHzの信号のオーバーライト特性を測定した。この結果 記録信号の C / N 比としては、5 5 d B 以上が得られ、オーバライトのサイクル特性については、特にビットエラーレイトの特性を測定した結果、10 9 サイクル以上劣化が見られなかった。

発明の効果

以上のように本発明によればGeTe、Sb2Te3、Sbに 窒素を混合した記録層を基板上に形成することに よって、記録・消去の繰り返しに伴い、記録層材 料が案内溝に沿って移動する現象を抑制し、これ によって記録・消去の繰り返し特性を向上する とができる。また、記録層と反射層の間の保護層 を薄くした急冷構成にすることによって、均一な 非晶質化が可能となり、 記録・消去特性が良好でかつ 1 0 *回以上の普換えが可能な光記録媒体を提供することができる。

4. 図面の簡単な説明

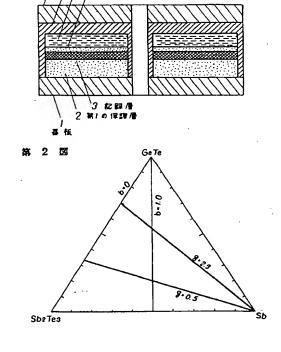
第1図は本発明の実施例における光記録媒体の 断面図 第2図は本発明の実施例における光記録 媒体の記録層のうち GeTe, Sb2Te3, Sbの組成を示し た三角ダイアグラム 第3図は従来の光記録媒体 の断面図である。

1 · · · 基板 2 · · · 第1の保護層 3 · · · 記録層 4 · · · · 第2の保護層 5 · · · 反射層 6 · · · 保護板 7 · · · 接着剤

代理人の氏名 弁理士 栗野重孝 ほか1名

第 1 図

保護 板



第 3 図

